PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05266000 A

(43) Date of publication of application: 15.10.93

(51) Int. CI

G06F 15/20 G05B 19/403 G06F 15/60

(21) Application number: 04094877

(22) Date of filing: 23.03.92

(71) Applicant:

MINOLTA CAMERA CO LTD

(72) Inventor:

IKEDA KATSUHIKO INOUE MASAKO BAN SHINICHI ENOMOTO YASUMI

(54) MECHANISM OPERATION SIMULATING SYSTEM CONSIDERING GEOMETRIC SHAPE

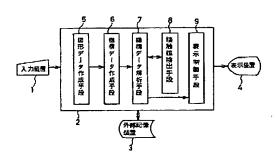
(57) Abstract:

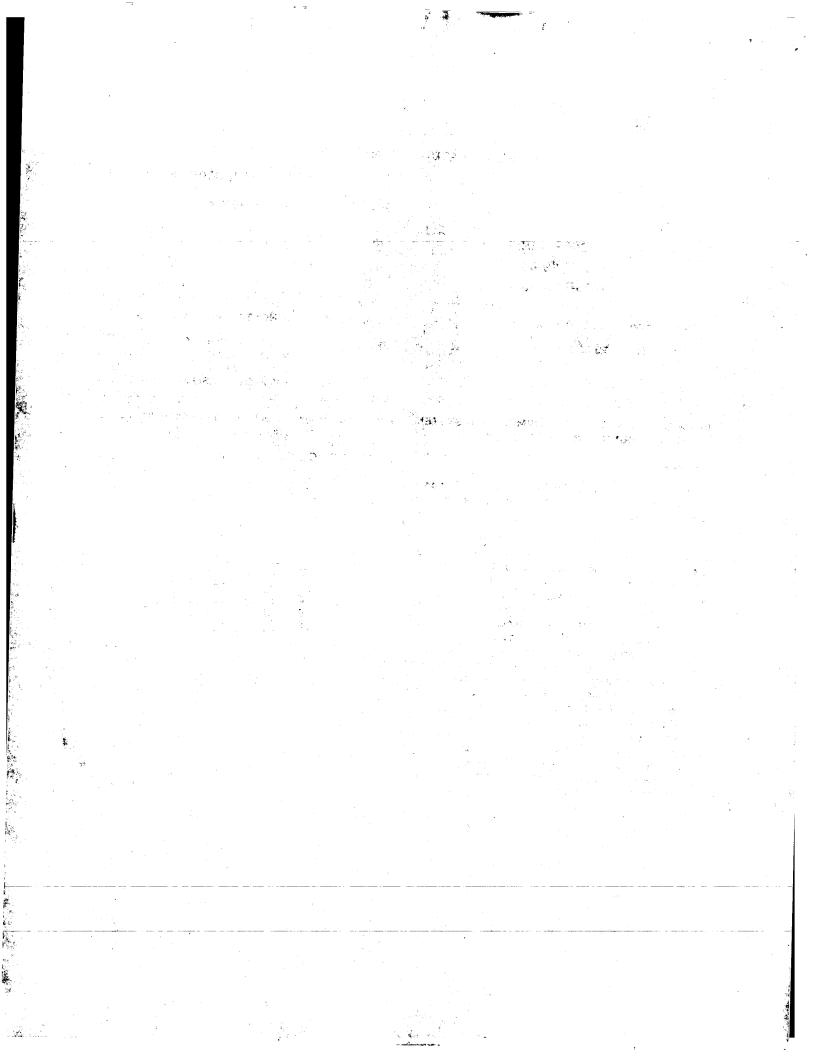
PURPOSE: To simulate the mutual contact motion of mechanism elements having three-dimensional free curved surfaces.

CONSTITUTION: An input device 1, a processor 2, an external storage device 3, and a display device 4 are provided, and a graphic data generating means 5, a mechanism data generating means 6, a mechanism data analyzing means 7, a contact value detecting means 8, and a display control means 9 are formed in the processor 2 by a program. The shape and the coupling state, etc., of the mechanism element are inputted to the graphic data generating means 5 and the mechanism data generating means 6. The mechanism element having the three-dimensional free curved surface approximated to a polyhedron by the mechanism data analyzing means 7 and the contact value detecting means 8, and the position and the posture of each mechanism element at the time when the mechanism elements are brought into contact, are linked, and are coupled with each other are calculated and analyzed from displacement for two mechanism elements to come into contact with each other, and the mutual contact motion

of the mechanism element having the three-dimensional free curved surface is simulated.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO& Japio





(19) B 本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平5-266000

(43)公開日 平成5年(1993)10月15日

(51) Int. C1. 5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G06F G05B

D 7218-5 L

E 9064-3 H

G06F 15/60

15/20

19/403

400 A 7922-5L

審査請求 未請求 請求項の数 1

FΙ

(全14頁)

(21)出願番号

特願平4-94877

(22)出願日

平成4年(1992)3月23日

(71)出願人 000006079

ミノルタカメラ株式会社

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号

大阪国際ビル

(72)発明者 池田 勝彦

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪

国際ビルミノルタカメラ株式会社内

(72) 発明者 井上 昌子

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪

国際ビルミノルタカメラ株式会社内

(74)代理人 弁理士 貞重 和生

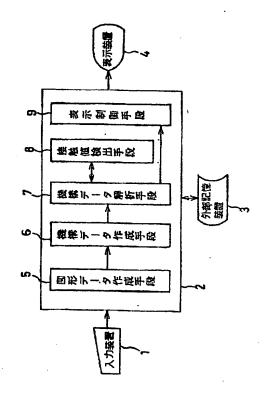
最終質に続く

(54) 【発明の名称】幾何形状を考慮した機構動作シミユレーションシステム

(57)【要約】

【目的】 3次元自由曲面をもつ機構部品相互の接触運動 をシミユレーションする。

【構成】入力装置1、プロセツサ2、外部記憶装置3、 表示装置4を備え、プロセツサ2内には図形データ作成 手段5、機構データ作成手段6、機構データ解析手段 7、接触値検出手段8、表示制御手段9がプログラムに より形成される。機構部品の形状、結合状態等を図形デ - 夕作成手段5、機構データ作成手段6に入力する。機 構データ解析手段7、接触値検出手段8により、3次元 自由曲面をもつ機構部品を多面体近似し、2つの機構部 品相互が接触する変位量から機構部品相互が接触連動結 合するときの各機構部品の位置、姿勢を演算解析し、3 次元自由曲面をもつ機構部品相互の接触運動をシミユレ ーションする。



特開平5-266000

【特許請求の範囲】

【請求項1】 鍵盤と表示装置と外部記憶装置とを備え、外部記憶装置内の情報に基づいてプロセツサ内に複数の機能手段を設定できる情報処理装置において、前記機能手段は、

1

入力された機構図形の位置、姿勢に関する図形データを 作成する図形データ作成手段と、

前記図形データに基づいて、機構を構成する機構部品に 分解し、各機構部品についての位置及び姿勢を表す機構 部品データ、2つの機構部品の結合による機構部品の自 由度を表す結合データ、及び機構部品を駆動する時期及 び変位を表す駆動データを編集する機構データ作成手段 と、

機構部品表面の自由曲面を多面体で近似して多面体相互 が接触するような変位量を求め、その変位量及びそれを 微小量増減させた変位量だけ部品を移動させて干渉を検 査することにより自由曲面相互が接触するときの変位量 の存在範囲を限定し、その範囲内で干渉検査を用いて逐 次収斂させることにより自由曲面を持つ機構部品相互が 接触連動するときの変位量を演算する接触値演算手段 と、

前記機構データ、及び接触値演算手段により演算された 接触連動結合するときの変位量に基づいて各機構部品の 位置、姿勢を算出する機構データ解析手段と、

各機構部品の位置、姿勢を可視的に表示装置に表示せし める表示制御手段とを含み、

接触連動結合するときの3次元の自由曲面をもつ機構の運動解析を行い、機構運動を可視的に表示することを特徴とする幾何形状を考慮した機構動作シミユレーションシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、コンピユータにより 機械装置に使用される機構の動作をシミユレーションす るシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】コンピュータにより機械装置に使用される機構の動作をシミュレーションすることは、機構設計において、機構部品相互の干渉その他の不具合を発見し、所定の動作を確認する上で重要なステツプである。従来から行われているコンピュータによる機構動作のシミュレーションにおいては、CAD(コンピュータを機構がであるという方法が採られている。ここで、図形データとは機構部品の形状を表し、機構データとは機構部品間の結合関係及び駆動の情報を表すものであるが、従来の機構動作シミュレーションシステムは、機構部品の表面形状まで考慮してシミュレーションするものはない。

[0003]

2

【発明が解決しようとする課題】上記したように、従来の機構動作シミユレーションシステムでは、機構部品の表面形状までは考慮されていないから、機構部品相互の表面の接触状態、例えばカムとカム従動子であれば、カムとカム従動子の表面の接触状態を考慮した機構の動作をシミユレーションすることはできず、複雑な形状のカムなどを使用する機構では、その動作を十分に解析できないという問題点があつた。

【0004】さらに、最近の機構は複雑な動作を実現す 3ため、機構部品として2次元形状ばかりでなく、3次 元の自由曲面を持つものが使用されるようになつてきたが、このような3次元の自由曲面を持つ機構部品相互の 表面の接触状態を考慮した機構の動作をシミユレーションすることは、従来の機構動作シミユレーションシステムでは、ますます困難となる。

[0005]

30

【課題を解決するための手段】この発明は上記課題を解決するもので、3次元の自由曲面をもつ機構部品相互の表面が接触した状態を、部品結合の1種とみて機構動作のシミユレーションを行うシミユレーション装置を提供するものである。

【0006】即ち、一般に2つの機構部品は、相互に接触している状態と、離れている状態との2つの状態があり、相互に接触している状態のときのみ、一方の機構部品の運動が他方に伝達される。2つの機構部品の表面が相互に接触して運動が伝達される機構結合を、ここでは「接触連動結合」と呼び、また、接触して運動が伝達される状態を「接触連動結合状態」と呼ぶことにする。接触連動結合が指定された2つの機構部品について、被駆動側の部品の運動のうち、ある軸に沿った並進運動と、ある軸の回りの回転運動との2つを考える。

【0007】接触連動結合状態にある3次元の自由曲面をもつ2つの機構部品の運動の解析は、まず、駆動側の機構部品に所定量の変位を与えたとき、2つの機構部品が接触する場合に、駆動側の機構部品に接するような被駆動側の機構部品の変位量を求める。これは、2つの機構部品の3次元の自由曲面の表面を、3角形の集合による多面体で近似し、多面体相互の接触により、自由曲面相互の接触による実際の変位量を含む範囲を求める。

40 【0008】即ち、まず、駆動側の機構部品の表面を表す多面体の1つの3角形に対して、被駆動側の機構部品の表面を表す多面体の1つの3角形が接するような被駆動側の機構部品の変位量を求める。3角形相互の接触は、一方の3角形領域の内部に他方の3角形の頂点が存在する場合、あるいは一方の3角形の稜線と他方の3角形の稜線とが交差する場合に起こり得る。

【0009】従つて、駆動側、被駆動側それぞれの機構 部品の表面を表す多面体を構成する各3角形に対して、 この条件を満たすような変位量を求めると、得られた変 位量は、実際の変位量の近似値の「候補」になる。言い 換えれば、実際の変位量は得られたいずれかの変位量の 近傍に存在する。何故ならば、注目している3角形以外 の3角形で干渉することや、多面体近似による誤差を考 感していないからである。

3

[0010] 駆動側の機構部品を得られた変位量分だけ 移動したとき、実際の機構部品(多面体で近似しない元 のもの)がどのような状態にあるかを調べるために、シ ステムの備えている干渉検査機能を利用する。即ち、先 に解析して得られた変位量に基づき、被駆動側の機構部 品の図形データを変位量分だけ移動させた図形データを 求め、この図形データと駆動側の機構部品の図形データ とから、2つの機構部品が干渉しているか、離れている かを検査する。次に、先に解析して得られた変位量を微 小量変化させて先と同様に干渉を検査する。この結果、 もしも、変位量を微小量変化させたとき、干渉している ものが干渉しなくなつたり、あるいは、離れているもの が干渉するようになるなど、前回の干渉検査の結果と異 なつた場合は、実際の機構部品(多面体で近似しない元 のもの)は元の変位量と微小量変化させた変位量との間 に存在することになる。

【0011】従つて、得られた変位量のうち、値の小さい類にこのような処理を行い、実際の変位量が存在する 範囲を得、さらに、この得られた変位量の範囲の中で、 解の精度を上げるために干渉検査の機能を利用し、逐次 収斂させて実際の変位量とみなせる値を求める。

【0012】このように、この発明では、接触連動結合する2つの機構部品を多面体で近似し、その場合の変位量が存在する範囲を限定し、更に2つの機構部品の干渉の状態を検査しつつ、変位量が存在する範囲を収斂させ、接触連動結合する2つの機構部品の被駆動側の実際の変位量を求めて機構動作のシミユレーションを行うようにしたものである。

【0013】その構成は、鍵盤と表示装置と外部記憶装 置とを備え、外部記憶装置内の情報に基づいてプロセツ サ内に複数の機能手段を設定できる情報処理装置におい て、前記機能手段は、入力された機構図形の位置、姿勢 に関する図形データを作成する図形データ作成手段と、 前記図形データに基づいて、機構を構成する機構部品に 分解し、各機構部品についての位置及び姿勢を表す機構 部品データ、2つの機構部品の結合による機構部品の自 由度を表す結合データ、及び機構部品を駆動する時期及 び変位を表す駆動データを編集する機構データ作成手段 と、機構部品表面の自由曲面を多面体で近似して多面体 相沍が接触するような変位量を求め、その変位量及びそ れを微小量増減させた変位量だけ部品を移動させて干渉 を検査することにより自由曲面相互が接触するときの変 位置の存在範囲を限定し、その範囲内で干渉検査を用い て逐次収斂させることにより自由曲面を持つ機構部品相 互が接触連動するときの変位量を演算する接触値演算手 段と、前記機構データ、及び接触値演算手段により演算

された接触連動結合するときの変位量に基づいて各機構 部品の位置、姿勢を算出する機構データ解析手段と、各 機構部品の位置、姿勢を可視的に表示装置に表示せしめ る表示制御手段とを含み、接触連動結合するときの3次 元の自由曲面をもつ機構の運動解析を行い、機構運動を 可視的に表示することを特徴とするものである。

[0014]

【作用】接触値演算手段は、機構部品表面の自由曲面を 多面体で近似して2つの機構部品相互の接触する変位量 を求め、これに基づいて3次元の自由曲面を持つ機構部 品相互が接触連動結合するときの変位量を求めるから、 3次元の自由曲面を持つ機構部品相互が接触連動結合す るときの各機構部品の位置、姿勢を漏れなく、且つ正確 に求めることができる。

[0015]

【実施例】以下、この発明の実施例について説明する。 【0016】この実施例は、CADで作成された図形データを機構部品に分解し、各機構部品に回転結合、並進結合、接触連動結合などの結合を示す機構データを付加し、機構部品に変位を与えたときの各機構部品の位置及び姿勢を、その機構データを解析することにより算出して求め、各機構部品図形を表示装置上に表示するようにした装置である。

【0017】まず、機構部品相互の回転結合、並進結合のみで、機構部品相互の表面が接触連動結合していない場合について、駆動側の機構部品に所定量の変位を与えたときの被駆動側の機構部品の変位量の演算について説明する。

【0018】図1は、3つの回転結合と1つの並進結合 を持つ4つの機構部品からなるリンク機構である。図において、機構部品10と11は軸14方向の並進運動が可能に結合されている。また、機構部品11と12、機構部品12と13、及び機構部品13と10とは、それぞれ、軸15の回りの回転運動、軸16の回りの回転運動、軸17の回りの回転運動が可能に結合されている。なお、機構部品10は接地されており、動かないものとする。

【0019】1つの剛体(機構部品)のもつ運動の自由度は、並進運動が3、回転運動が3で、合計6つの自由程があるが、各機構部品間の結合は、2つの機構部品間の相対運動における自由度を拘束するから、上記したリンク機構では、機構部品10と11は軸14方向の並進運動のみ、機構部品11と12は軸15の回りの回転運動のみ、機構部品12と13は軸16の回りの回転運動のみ、機構部品13と10は軸17の回りの回転運動のみ、機構部品13と10は軸17の回りの回転運動のみが許されており、その他の運動は拘束されていることになる。

【0020】上記の結合状態を数学的に記述すれば、以下の通りとなる。

50 【0021】まず、2部品間の相対的位置及び姿勢の変

(4)

特開平5-266000

5

化を表すために、基準座標系以外にそれぞれの部品上に 局所座標系を設定する。それぞれの局所座標系は、それ が設定された機構部品と共に移動(並進、回転)するも のとする。

【0022】図2は機構部品18が軸19の回りに回転 運動する例で、局所座標系00-X0, Y0, Z0も機 構部品18と共に回転運動する。いま、機構部品18が 軸00-Z0の回りに角度θだけ回転し、位置18aに 移動したものとすると、この回転運動による位置及び姿 勢の変化は、移動前の座標系00-X0, Y0, Z0と 移動後の座標系01-X1, Y1, Z1との変化で表す* *ことができる。

【0023】即ち、移動後の原点01 を移動前の座標系00-X0, Y0, Z0で表した座標値01 (Xm, Ym, Zm)とし、移動前の座標軸(00 X0, 00 Y0, 00 Z0)と移動後の座標軸(01 X1, 01 Y1, 01 Z1)の各々が交差する角の方向余弦をαとすると、移動後の座標系における座標値(X1, Y1, Z1)は移動前の座標系における座標値(X0, Y0, Z0)に対して、以下のように表わすことができる。

※このA行列を使つて、図2の場合を説明する。機構部品

20 10乃至と13に局所座標系を設定すると次の式が成立

6

10 [0024]

【数1】

する。

[0027]

X 1	a 11	a. 12	α 13	Хm	X O
Y1	a 21	a 22	a 23	Ym	Y O
Z 1	a 31	a 32	a 33	7.m	Z 0
1	0	0	0	1	1

[0025] 図2の場合は、軸00 - Z0 の回りに角度 θ だけ回転しているから、前記A行列は以下のように表される。

[0026]

数2】

$\cos \theta$	-sin $ heta$	0	O
sin 0	$\cos heta$	0	U
0	0 .	1	O
0	0	0	1

30

 $M1AA2(\theta 1)MA2 \cdot M2AA3(\theta 2)MA3 \cdot M3AA4(\theta 3)MA4 \cdot$

 $M4AA1(\theta 4)MA1=1$

但し、MiA:結合の初期状態を局所座標系iで表したと きの行列式

MAj:結合の初期状態を局所座標系jで表したときの行列式

Ai :結合の初期状態からの変換行列

θi:回転量あるいは並進量

回転量あるいは並進量が θ 1 である場合、上記 (1) 式に θ 1 を代入し、例えばニュートン・ラフソン法により θ 2 、 θ 3 、 θ 4 を求める。 L1 を局所座標系を基準座 標系で表したときの行列式とすると、各機構部品の位置 の変換行列は、以下のように表される。

[0028] L1

 $L1 - M1AA2(\theta 1)MA2$

L1 \cdot M1AA2(θ 1)MA2 \cdot M2AA3(θ 2)MA3

L1 · M1AA2(θ 1)MA2 · M2AA3(θ 2)MA3 · M3AA4 (θ 3)MA4

(1)

以上は、機構部品相互の回転結合、並進結合のみで、機 40 構部品相互の表面が接触連動結合していない場合につい て、駆動側の機構部品に所定量の変位を与えたときの被 駆動側の機構部品の変位量の演算について説明したもの で、これにより、各機構部品の位置及び姿勢を知ること ができる。

【0029】機構部品相互の表面が接触連動結合している場合も、同様に上記したA行列を求めることで、各機構部品の位置及び姿勢を知ることができる。しかしながら、この場合は、機構部品相互の表面の形状が様々であるから、上記した場合のように一般式でA行列を記述できないので、後述するように、機構部品相互の表面の形

(5)

特開平5-266000

7

状を多面体で近似したデータにより、実際の変位量を包含するような変位量の存在範囲を求め、システムが備える干渉検査機能を用いてその範囲内で逐次収斂させて実際の変位量を得、それをA行列で記述するようにすればよい。

【0030】図3は、この発明のシミユレーション装置の構成の概略を示すプロツク図で、1は鍵盤、マウス等の入力装置、2はプロセツサ、3は磁気テープ、磁気デイスク等の外部記憶装置、4はCRT、プリンタ等の表示装置である。プロセツサ2内には、外部記憶装置3から読み込まれたプログラムにより、図形データ作成手段5、機構データ作成手段6、機構データ解析手段7、接触値検出手段8、表示制御手段9が構成される。

【0031】図形データ作成手段5は、入力装置1から入力された機構部品の図形の位置、姿勢などの情報を、

機構部品数

機構部品情報-機構部品番号

- 一位置姿勢行列
- 一構成要素数
- 一構成要素情報-要素番号

一要案形式。

【0034】(b) 結合データは、機構部品情報で表される各機構部品について、2つの機構部品間の相対運動における自由度の拘束情報等を表す。自由度の拘束情報 ※

結合数

結合情報一結合番号

- 一結合種類
- 結合される機構部品番号 (1)
- 結合される機構部品番号 (2)
- -機構部品番号(1)の結合情報
- -・機構部品番号(2)の結合情報。

【0035】(c) 駆動データは、機構を駆動するときの情報を表す。駆動データは、およそ以下の種類の情報からなる

駆動数

駆動情報ー駆動側の機構部品番号

- -駆動方法
- 一変位数
- 一変位情報一時刻

一変位。

【0036】機構データ解析手段7は、機構データ作成手段6で作成された機構データを解析し、機構部品を駆動したときの、各機構部品の位置及び姿勢を算出する。 【0037】接触値検出手段8は、機構データに機構部品相互の接触を伴う結合、即ち接触連動結合がある場合に、機構部品の移動量を算出する。算出された移動量は、機構データ解析手段7により機構部品の位置及び姿勢に変換される。

【0038】表示制御手段9は、機構データ解析手段7、及び接触値検出手段8により求められた各機構部品

に保持された図形データに対応する機構部品について、機構部品に関する情報、機構部品相互の結合に関する情報、機構部品のうち駆動側となるもの、等の情報を入力装置1から入力することにより、プロセツサ2内に機構10 解析のための機構部品情報、結合情報、駆動情報などの

*図形データとしてプロセツサ2内に保持させるものであ

る。図形データは、ソリツド、サーフエイス、ワイヤフ

レームなどの図形要素形式、図形要素識別番号、及び図

【0032】機構データ作成手段6は、プロセツサ2内

形形状データから構成される。

解析のための機構部品情報、結合情報、駆動情報などの 機構データを作成する。機構データは、図形データを機 構部品に分けたときの各機構部品の位置及び姿勢を求め る単位である。

【0033】(a)機構部品情報はおよそ以下の種類の情報からなる。

※のうち、代表的なものが結合として登録される。結合データは、およそ以下の種類の情報からなる。

の位置及び姿勢を、図形データ、及び表示パラメータに 基づいて表示図形情報に変換し、表示装置4に表示す ス

【0039】図4は、プロセツサ2で実行される処理プロセスを示すフローチヤートである。電源が投入されると、まず、前処理として、初期設定がなされ、外部記憶3からプログラムが読み込まれ、プロセツサ2内に、図形データ作成手段5、機構データ作成手段6、機構データ解析手段7、接触値検出手段8、表示制御手段9が構成される(ステツプP1)。

【0040】鍵盤、マウス等の入力装置1により所望の 図形の作図操作を行う。作成された図形は図形データ作 成手段5により処理され、図形データが作成される(ス テツプP2)。

【0041】機構データ作成手段6により、作成された 図形データを機構部品に分け、各機構部品に関する機構 データ、結合データ、駆動データが作成される(ステツ プP3、P4)。

50 【0042】図形データを機構部品に分ける処理は、入

受信時刻 7月 8日 11時15分

力装置1により指定の機構部品に対する図形データを指 定すると、機構部品の構成が解析され、上記したような 機構データが形成される。

【0043】結合データの処理は、入力装置1により結 合される2つの機構部品を指定し、その2つの機構部品 間に定義したい結合を選択する。このとき、結合の種類 によりパラメータを入力する場合がある。入力情報は機 構データ作成手段6により選択された結合が解析されく 上記したような結合データが形成される。

【0044】駆動データの処理は、入力装置1により駆 動側の機構部品、駆動方法、駆動時刻、駆動量を入力す る。入力情報は機構データ作成手段6により駆動状態が 解析され、上記したような駆動データが形成される。

【0045】機構部品データ及び結合データに基づい て、結合状態にある機構部品群の最初の部品と最後の部 品が結合して閉ループを形成しているものと、このよう な閉ループを形成せず、開ループを形成しているものと に分ける(ステツプP5)。____

【0046】定義された結合のうち、機構部品間の接触 を伴う接触連動結合については、接触値を求めるため (※、機構部品の表面を3角形の集合による多面体で近似 し、各3角形の頂点の座標を基準座標系で表す(ステツ プP6)。

【0047】機構部品を時系列で定義されている複数の 駆動データについて、全て演算処理が終了したか否かを 判定し(ステツプP7)、演算処理が終了していないと きは、後述するステツプP8~ステツプP15の演算処 理を繰り返し、演算処理が終了しているときは、ステツ プP16に移り、記憶装置に格納された位置及び姿勢デ ータに基づいて、表示装置上に各機構部品の位置及び姿 勢を表示する。

【0048】以下は、ステツプP8~ステツプP15で 実行される演算処理についての説明である。

【0049】まず、機構部品に駆動データで指定された 駆動情報を与える。もし、接触連動結合が関係しない場 合は、先に説明した方法で解析することができるが、接 触連動結合が関係する場合は、図形データの位置関係が 問題となるので、機構部品の図形データを駆動情報に基 * *づいて移動させる。即ち、接触連動結合が関係する駆動 側の機構部品に対して、この機構部品のA行列を図形デ ータに作用させる。例えば、図形データがNURBS表 現であらわされている場合、制御点にA行列を掛けて制 御点を移動させる(ステツプP8)。

【0050】移動させた機構部品のうち、接触運動結合 が定義されている2つの機構部品が接触したか否かを判 定する(ステツプР9)。これは、ステツプР8で得ら れた移動後の図形データに、システムが備えている干渉 判定機能を利用して、2つの機構部品が干渉している か、離れているかを調べることにより実施される。

【0051】ステツプP9の判定で、2つの機構部品が 接触運動結合していない場合は、まず、閉ループを形成 しているか否かを調べ、閉ループを形成している場合 は、先に説明したニユートン・ラフソン法により演算し てA行列を求める。また、開ループを形成していない場 合は、機構部品を順次変位させ、その変位を計算してA 行列を求める(ステツプP14)。

【0052】駆動情報に基づいて各機構部品の位置及び 姿勢を演算して(ステツプP15)、ステツプP7に戻

【0053】ステツプP9の判定で、接触連動結合の2° つの機構部品が干渉する場合は、2つの機構部品は連動 すると考えられるので、接触値検出手段8により駆動側_ の(移動後の)図形データに接するような被駆動側の機 構部品の変位量を計算する。即ち、多面体で近似した機 構部品の表面データのうち、駆動側の機構部品を表す多 面体データを駆動量分移動させて、被駆動側の機構部品 を表す多面体データがこれに接するような変位量を求め る(ステツプP10)。

【0054】駆動側の機構部品を表す多面体データを駆 動量分移動させるには、駆動側の機構部品を表す多面体 データの各3角形の頂点座標値に、駆動量を表す以下説 明するA行列を掛ければよい。軸の端点座標を(x、 y、z)、軸の正規化された方向ベクトルを(a、b、 c) としたとき、A行列は以下の式で表される。

[0055]

【数3】

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c & -ax-by-cz \\ -ab/\sqrt{a^2+c^2} & \sqrt{a^2+c^2} & -bc/\sqrt{a^2+c^2} & abx/\sqrt{a^2+c^2} & -y\sqrt{a^2+c^2} \\ -c/\sqrt{a^2+c^2} & 0 & a/\sqrt{a^2+c^2} & cx/\sqrt{a^2+c^2} & -az/\sqrt{a^2+c^2} \end{bmatrix}$$

(7)

特開平5-266000

12

多面体データ相互が接する場合とは、多面体を構成する 3角形のうち、いずれかの3角形相互が接する場合で、 以下の3つの場合がある。

11

- (1) 駆動側の多面体を構成する3角形領域内部に被駆動 側の多面体を構成する3角形の頂点が存在する場合
- (2) 被駆動側の多面体を構成する3角形領域内部に駆動 側の多面体を構成する3角形の頂点が存在する場合
- (3) 駆動側の多面体を構成する3角形の稜線と被駆動側 の多面体を構成する3角形の稜線が交差する場合。

【0056】以下、被駆動側の機構部品の運動が並進運動の場合について、上記(1)(2)(3)について変位量を計算する。

【0057】(1) の場合、駆動側の多面体を構成する3 角形の頂点の座標を(Xf1, Yf1, Zf1), (Xf2, Yf2, Zf2), (Xf 3, Yf3, Zf3) とし、被駆動側の多面体を構成する3角形 の頂点の頂点の座標を(Xm, Ym, Zm)とすると、変位量 Hは 以下の連立方程式を解くことにより得られる。

 $\[\] \] \alpha *(Xf2-Xf1) + \beta *(Xf3-Xf1) + Xf1 = Xm+H \] \alpha *(Yf2-Yf1) + \beta *(Yf3-Yf1) + Yf1 = Ym \] \alpha *(Zf2-Zf1) + \beta *(Zf3-Zf1) + Zf1 = Zm \] 0 ≤ α ≤ 1 , 0 ≤ β ≤ 1 \]$

(2) の場合、駆動側の多面体を構成する3角形の頂点の 座標を(Xf, Yf, Zf)とし、被駆動側の多面体を構成する3 角形の頂点の頂点の座標を(Xm1, Ym1, Zm1), (Xm2, Ym2, Zm 2), (Xm3, Ym3, Zm3) とすることにより、変位量 Hは(1) の場合と同様にして得られる。

【0059】(3) の場合、駆動側の多面体を構成する3 角形の頂点の座標を(xf1, yf1, zf1), (xf2, yf2, zf2) と し、被駆動側の多面体を構成する3角形の頂点の頂点の 座標を(xm1, ym1, zm1), (xm2, ym2, zm2) とすると、変位量 Hは以下の連立方程式を解くことにより得られる。

[0 0 6 0] $\alpha * (Xf2-Xf1) + xf1 = \beta * (Xm2-Xm1) + Xm1+H$ $\alpha * (Yf2-Yf1) + Yf1 = \beta * (Ym2-Ym1) + Ym1$ $\alpha * (Zf2-Zf1) + Zf1 = \beta * (Zm2-Zm1) + Zm1$

 $0 \le \alpha \le 1$, $0 \le \beta \le 1$

次に、被駆動側の機構部品の運動が回転運動の場合について、上記(1)(2)(3)について変位量を計算する。

【0061】(1) の場合、駆動側の多面体を構成する3 角形の頂点の座標を(Xf1, Yf1, Zf1), (Xf2, Yf2, Zf2), (Xf 3, Yf3, Zf3) とし、被駆動側の多面体を構成する3角形 の頂点の頂点の座標を(Xm, Ym, Zm)とすると、変位量 Hは 以下の方程式を解くことにより得られる。

[0062] $\alpha * (Xf2-Xf1) + \beta * (Xf3-Xf1) + Xf1 = Xm { <math>\alpha * (Yf2-Yf1) + \beta * (Yf3-Yf1) + Yf1 }^{2}$

+ $\{\alpha*(Zf2-Zf1)+\beta*(Zf3-Zf1)+Zf1\}^2 = Ym^2 + Zm^2$ これらを解いて得られた α 、 β のうち、

 $0 \le \alpha \le 1$ 、 $0 \le \beta \le 1$ 、 $0 \le \alpha + \beta \le 1$ を満たすもの について、

 $Yi = \alpha * (Yf2 - Yf1) + \beta * (Yf3 - Yf1) + Yf1$

Zi= α*(Zf2-Zf1)+ β*(Zf3-Zf1)+Zf1 とすると、回転

角のは、以下の式で表される。

【0063】 (Zm/Ym) < (Zi/Yi) のとき、 $\theta = \cos^{-1} \{(Yi*Yw+Zi*Zm)/(Ym^2 + Zm^2)\}$ 上記以外のとき、

 $\theta = 2*\pi - \cos^{-1} \{ (Yi*Ym+Zi*Zm)/(Ym^2 + Zm^2) \}$

(2) の場合、駆動側の多面体を構成する3角形の頂点の 座標を(Xf1, Yf1, Zf1)とし、被駆動側の多面体を構成す る3角形の頂点の頂点の座標を(Xm1, Ym1, Zm1), (Xm2, Ym 2, Zm2), (Xm3, Ym3, Zm3) とすることで、変位量 Hは(1) の場合と同様にして得られる。

【0064】(3) の場合、駆動側の多面体を構成する3 角形の頂点の座標を(xf1, yf1, zf1), (xf2, yf2, zf2) と し、被駆動側の多面体を構成する3角形の頂点の頂点の 座標を(xm1, ym1, zm1), (xm2, ym2, zm2) とすると、変位量 Hは以下の連立方程式を解くことにより得られる。

【0065】 $\alpha*(Xf2-Xf1)+xf1=\beta*(Xm2-Xm1)+Xm1$ { $\alpha*(Yf2-Yf1)+Yf1$ } $^2+$ { $\alpha*(Zf2-Zf1)+Zf1$ } $^2=$ { $\beta*(Ym2-Zm1)+Ym1$ } $^2+$ { $\beta*(Zm2-Zm1)+Zm1$ } 2 これを解いて得られた α 、 β のうち、

20 $0 \le \alpha \le 1$ 、 $0 \le \beta \le 1$ を満たすものについて、

 $Yi = \alpha * (Yf2 - Yf1) + Yf1$

 $Zi = \alpha * (Zf2-Zf1) + Zf1$

 $Yo = \beta * (Ym2-Ym1)+Ym1$

Zo= β*(Zm2-Zm1)+Zm1 とすると、

回転角のは、以下の式で表される。

【0066】 (Zo/Yo) < (Zi/Yi) のとき、 $\theta = \cos^{-1} \{ (Yi*Yo+Zi*Zo)/(Yo^2 + Zo^2) \}$ 上記以外のとき、

 $\theta = 2 * \pi - \cos^{-1} \{ (Yi * Yo + Zi * Zo) / (Yo^2 + Zo^2) \}$

30 算出された変位量は、一般に複数個あり、且つ、実際の変位量とは異なる場合がある。これは、算出時に用いた3角形以外のところで干渉したり、多面体で近似することによる誤差による。逆に、実際の変位量は算出された変位量のいずれかの近傍に存在する。そこで、被駆動側の機構部品を算出された変位量だけ移動させ、干渉検査機能を用いて駆動側の機構部品と干渉しているか否かを調べる。さらに、算出された変位量を微小量増減させて駆動側の機構部品と干渉しているか否か干渉検査を行う。これを算出した変位量の小さい値から順次行い、干渉している状態から非干渉の状態(離れた状態)に変化

【0067】実際の変位量は、近似計算で得られた上記 Hlow とHhighとの間に存在するから、この区間内で干 捗検査の機能を用いた逐次近似計算を行う。許容誤差 & に対して、第1次近似の変位量

H1 = (Hlow + Hhigh) / 2

だけ被駆動側機構部品を移動させたとき、干渉するか否かを調べる。

50 【0068】干渉している場合は、第2次近似の変位量

13

H2 = (H1 + Hhigh) / 2

だけ被駆動側機構部品を移動させたとき、干渉するか否かを調べる。

【0069】以下、干渉が生じるまで、逐次近似計算を 行い、前回の計算で得た近似値と今回の近似値との差が ε以下になつた場合は、今回の近似値を実際の値とみな し、計算を終了する(ステツプP12)。

【0070】以上の近似計算で得られた変位量を、接触連動結合の場合の被駆動側機構部品の変位量としてA行列で表現し、機構データ解析手段7において各機構部品の位置及び姿勢を算出し、位置及び姿勢データとして記憶装置に格納する(ステツプP13)。記憶装置に格納される各機構部品の位置及び姿勢データは、基準時刻からの経過時間と、その時点における各機構部品の位置及び姿勢データから構成される。

【0071】次に、上記したシミュレーションシステムで解析した、接触連動結合する機構部品の解析例を説明する。図5は接触連動結合する丸ム機構を示すもので、機構部品B1とB2は、それぞれ軸a1及びa2の回りに回転するよう構成されている。いま、機構部品B1を軸a1の回りに10度づつ2回、回転駆動を与えるものとする。

【0072】図6は、先に説明した図4のフローチャートのステツプP6における処理により、前記カム機構のカム表面(曲面)を3角形の多面体で近似した状態を示し、図7は機構部品B1の多面体を構成する3角形の頂点座標値の一例、図8は機構部品B2の多面体を構成する3角形の頂点座標値の一例を示すものである。

【0073】図9は、機構部品B2を駆動側、機構部品B1を被駆動側とした場合の、前記フローチャートのステップP10乃至P13による解析結果の一例を示ものである。即ち、多面体で近似した機構部品について変位量(回転角ラジアン)を算出し、干渉検査の結果、変位量0.068737では干渉しておらず、変位量0.108737では干渉していることが判明したので、解が存在する範囲はこの範囲にあると判断する。そこで、逐次近似計算して、干渉しない最大値と干渉する最小値との差をが0,001以下となつたとき計算を打ち切り、干渉しない最大値0.107487と干渉する最小値0.108737の中間値である値0.108112(回転角ラジアン)を機構部品B1とB2が接触する変位量として決定する。即ち、機構部品B1を0.108112ラジアン回転させたとき、機構部品B2に接触するすることが分かる。

【0074】次に、表示装置における表示の態様について説明する。時間と共に変位する機構の表示態様としては、例えば、駆動情報に基づいて各機構部品の位置及び姿勢を時系列で順次表示する方法、指定時刻における各機構部品の位置及び姿勢を表示する方法、各機構部品の移動開始から移動終了までの部品間の距離や干渉曲線を表示す

14

る方法などがある。接触連動結合の場合は、離れている 状態から接触する状態までの各機構部品の位置及び姿勢 を表示することもできる。

【0075】図10は図1に示すリンク機構の位置及び姿勢を時系列で順次表示した例で、時間の経過につれて変位する機構部品の位置及び姿勢を立体的に表示することができる。図11は機構部品の初期位置の形と、移動軌跡だけを表示した例、図12は機構部品の移動中の干渉状態を示す干渉曲線を表示した例である。図13乃至10 図15は接触連動結合するカメラのAFカプラー機構の位置及び姿勢を立体的に表示した例である。また、図16は接触連動結合しているカムで、図17乃至図21は図16のカムにおいて、回転角の変化に応じてレバーが変位する様子を表示した例である。

[0076]

【発明の効果】以上説明した通り、この発明は機構部品相互の接触状態を部品結合の1種とみてこれを接触連動結合と定義し、機構部品の3次元の自由曲面を多面体で近似した機構部品について演算して得た位置、姿勢から、実際の機構部品が接触連動結合するときの位置、姿勢を求めるようにし、機構部品に変位を与えながら接触連動結合するとき、及び接触連動結合しないときの機構部品の位置、姿勢を順次演算し、機構部品表面の接触による機構の動きを含めて、機構の動作を解析するものであるから、従来のシミュレーションシステムでは実施できなかつた、3次元の自由曲面をもつ機構部品相互の接

とができる。 【図面の簡単な説明】

0 【図1】機構部品相互の回転結合、並進結合を説明する リンク機構の斜視図。

触状態を考慮した機構の動作をシミユレーションするこ

【図2】回転結合した2つの機構部品の解析説明図。

【図3】この発明のシミユレーション装置の構成の概略 を示すプロツク図。

【図4】プロセツサで実行される処理プロセスの概略を 示すフローチャート。

【図5】接触連動結合するカム機構の斜視図。

【図6】図5に示すカム機構のカム表面(曲面)を3角形の多面体で近似した状態を示す斜視図。

40 【図7】図6に示す多面体で近似したカム機構のうち、 機構部品B1表面の3角形の頂点座標値の一例。

【図8】図6に示す多面体で近似したカム機構のうち、 機構部品B2表面の3角形の頂点座標値の一例。

【図9】図6に示す多面体で近似したカム機構の解析例。

【図10】機構部品の位置及び姿勢を時系列で順次表示 した表示例。

【図11】機構部品の初期位置の形と、移動軌跡だけを 表示した表示例。

50 【図12】機構部品の移動開中の干渉状態を示す干渉曲

15

線を表示した表示例。

[図13]接触連動結合するカメラのAFカプラー機構の表示例(その1)。

【図14】接触連動結合するカメラのAFカプラー機構の表示例(その2)。

[図15] 接触連動結合するカメラのAFカプラー機構の表示例(その3)。

【図16】接触連動結合しているカムの一例を示す斜視 図。

【図17】図16に示すカムの回転角の変化に応じたレ パーの変位の表示例(その1)。

【図18】図16に示すカムの回転角の変化に応じたレバーの変位の表示例(その2)。

【図19】図16に示すカムの回転角の変化に応じたレバーの変位の表示例(その3)。

【図20】図16に示すカムの回転角の変化に応じたレバーの変位の表示例(その4)。

(9)

特開平5-266000

16

【図21】図16に示すカムの回転角の変化に応じたレバーの変位の表示例(その5)。

【符号の説明】

10、11、12、13、14、18、18 a:機構部 品

14:並進運動軸

15、16、17、19:回転運動軸

1:入力装置

2:プロセツサ

10 3:外部記憶装置

4:表示装置

5:図形データ作成手段

6:機構データ作成手段

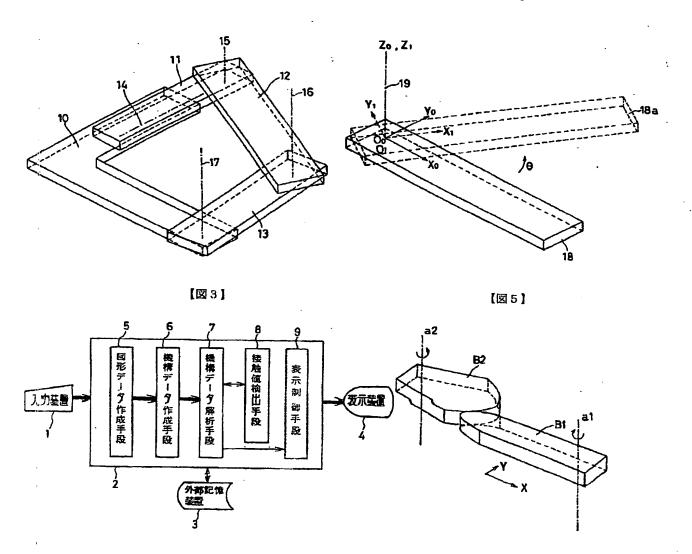
7:機構データ解析手段

8:接触值検出手段

9:表示制御手段

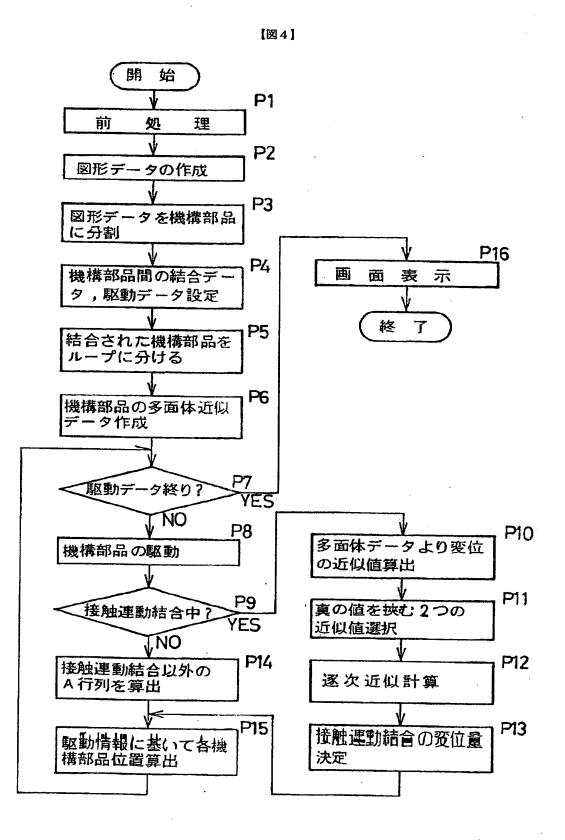
【図1】

【図2】



(10)

特開平5-266000



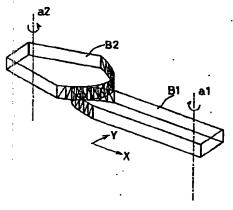
受信時刻 7月 8日 11時15分

(11)

特開平5-266000

【図6】

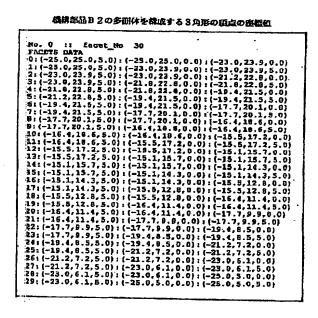


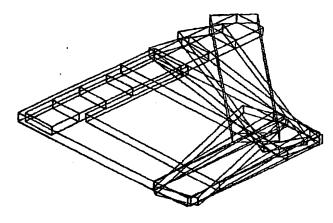


o. 1 :: facet No	30 ·
ACETS DATA	
(-1.3,1.5,3.0);(-7.	3,1.6,0.0): (-9.3,1.4,0.0)
\~'.J.1.b.D.U!! (~9.	.4.1.4.D D) / / 0 1 1 4 5 ci
1-3.3.1.4.3.011(-9.	3.1.4.0 011/ 77 2 3 4 4 4 4 4
1-3,3,4,4,3,0):(-13	3,1,3,0.0): (-11,3,1,3,5.0)
(-11 9 1 3 E A) . (a	1.3, 1.3, 0.0): (-13.1, 1.3, 0.0)
/-12 3 1 9 E 00 . 4 2	3.1, 1.3, 0.0) : (-13.1, 1.3, 5.0)
(-13 · 1, 1 · 3, 3 · 0) (-1	3.1, 1.3.0.0) : (-15.0, 1.4, 0.0)
1-15 D 1 4 5 0) : (-1	5.0,1.4,0.0): (-15.0,1.4,5.0)
1-15.0, 2.4, 5.0) ; (-1	5.0,1.4,0.0): (-16.5,1.6,0.0) 6.5,1.6,0.0): (-16.5,4.6,5.0)
: (-16.5.1 6.5 0): (-1	16.5,1.6,0.0): (-16.5,4.6,5.0)
: (-16.5.1 6.5 0) . (-	17.5, 2.0, 0.0) : (-17.5, 2.0, 0.0)
(-17.5.2.0.5.0)	17.5,2.0,0.0): (-18.2,2.5,0.0)
(-17.5.2.0.5.0)	18.2,2.5,0.0): (-18.2,2.5,5.0)
: (-18.2.2.5.5.0) - (-	18.2,2.5,0.0): (-18.5,3.2,0.0)
(-18.2.2.5.5.0)	18.5,3.2,0.0): (-18.5,3.2,5.0)
. L_Y0.3.3.X.2.0.01:1-	18.5.7.7.8 N.o/_10 4 4 4 4 4
;	18.4.4.7.0 Ole/_20 2 4 4 c oi
	18. 7 4 7 0 01. (~) 7 7 6 6 6 6 6
:	17.7-5.0 0 DN:/-17 7 R A P Ai
\	17.7.5 0.0 DL /-16 7 6 0 0 0 i
(\ / ,	15.7.5.2.0.01./_tc 7 c a c ai
(-15,/,6,2,5,0) t (-)	16.7.6.7.0 01 1 - 15 4 7 4 0 4 1
1-10, /, 0, 2, 5, G) 1 (-)	15.4.7.4.6 01 · /=16 4 7 4 8 A
(-15.4, /.4, 5.8) (-)	15.4.7.4.0 01 1 /- 12 0 0 c 0 Ai
: {-L3.4,7.4,5.0}:[-	13.9.8.5.0.0): t=13.0.0 & 5 ni
(*13.9.8.6.5.0) t (-)	13.9.8.5 D 0) · /19 A 0 0 0 m
(-13.9.8.6.8.0) : (-)	12.4.9.8.0 01./_12.4 0 0 0 0 n
\	12.9.9.R.B D1./_10 7 11 0 0 0 0
(-12.4,9.8,5.0):(-)	10.7,11.0,0.0): (-10.7,11.0,5.0)

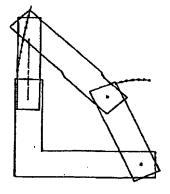
[図8]

【図10】

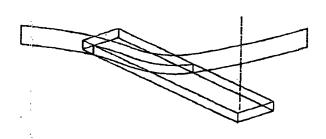




[図12]



【図11】



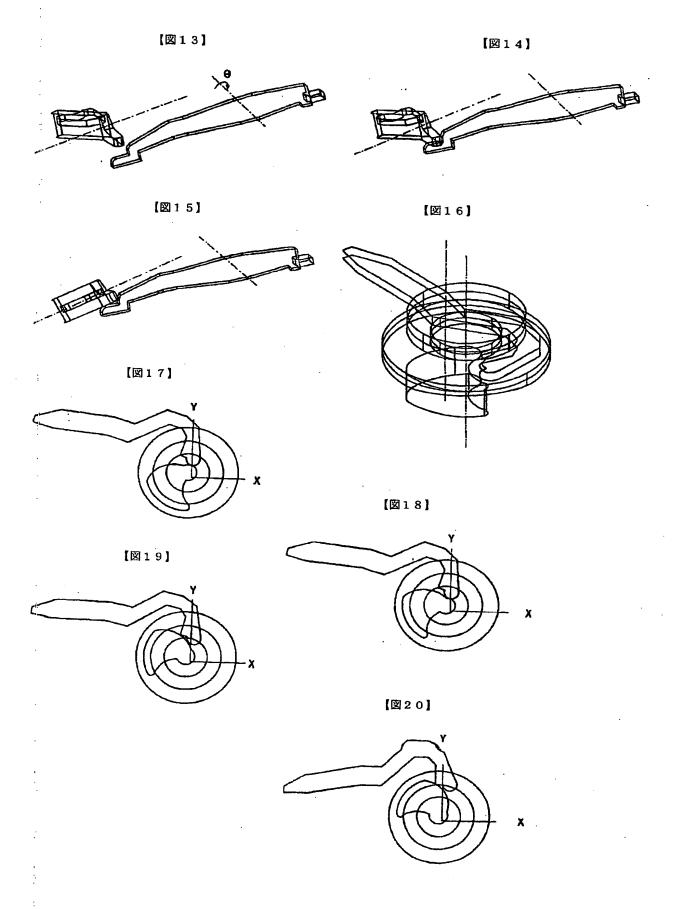
受制刻 7月 8日 11時15分

(12)

特開平5-266000

【図9】

多面体による接触解(1) 0.108737 (2) 0.109384 (3) 0.109507 (4) 0.109024 (5) 0.110010 (6) 0.112604 (7) 0.114560 (8) 0.117133 (0) 0.117971 (11) 0.119138 (12) 0.120821 (13) 0.122340 (14) 0.127401 (15) 0.120130 (16) 0.130803 (17) 0.136224 (18) 0.141629 (18) 0.141629 (18) 0.145656 (20) 0.149136 (21) 0.157337 (22) 0.162458 (23) 0.173213 (24) 0.174206 (25) 0.179607 (26) 0.187877 (27) 0.205283 (20) 0.215404 (28) 0.229018 (30) 0.288550 (31) 0.249459 (32) 0.263544 (33) 0.289062 (34) 0.295630 (35) 0.316064 (30) 0.318024 (37) 0.333534 (38) 0.344415 (30) 0.362347 (40) 0.375101	(41) 0.370882 (42) 0.308828 (43) 0.406779 (44) 0.421081 (45) 0.433405 (46) 0.430848 (47) 0.438226 (48) 0.439585 (40) 0.430824 (50) 0.446178 (51) 0.455440 (52) 0.458350 (53) 0.403454 (54) 0.463537 (55) 0.460106 (56) 0.474411 (57) 0.480888 (58) 0.481008 (59) 0.482372 (60) 0.485070 (61) 0.487814 (12) 0.401406 (03) 0.401666 (04) 0.492601 (65) 0.403350 (66) 0.405218 (67) 0.405472 (68) 0.40537 (69) 0.40683 各席に対する干渉検査 0.068737: NOT INTERSECT 0.108737: INTERSECT Wが存在する範囲 DOWN 0.068737: NOT INTERSECT 0.108737: NOT INTERSECT 0.108737: NOT INTERSECT 0.103737: NOT INTERSECT 0.105237: NOT INTERSECT 0.105237: NOT INTERSECT
	0.107487: NOT INTERSECT 档块 answer = 0.108112
	1

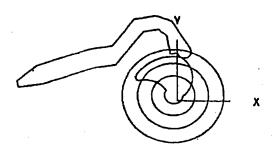


受調 7月 8日 11時15分

(14)

特開平5-266000

【図21】



フロントページの続き

(72)発明者 伴 慎一

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪 国際ビルミノルタカメラ株式会社内 (72)発明者 榎本 靖美

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪 国際ピルミノルタカメラ株式会社内